

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成23年10月13日 (2011.10.13)

【公開番号】特開2010-60326(P2010-60326A)

【公開日】平成22年3月18日 (2010.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2010-011

【出願番号】特願2008-223788(P2008-223788)

【国際特許分類】

G 0 1 B 5/20 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 5/20 D

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月31日 (2011.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

眼鏡フレームの右レンズ枠及び左レンズ枠をそれぞれクランプするクランプピンを持ち、
右レンズ枠及び左レンズ枠の左右方向（X方向）に対してフレーム装用時の縦方向（Y方
 向）から右レンズ枠及び左レンズ枠を押圧して保持する第 1 スライダー及び第 2 スライダ
 ーを有する眼鏡フレーム保持手段と、
測定子をレンズ枠の溝に沿って移動させる測定子移動機構を有する測定ユニットであって
、レンズ枠の動径方向（XY方向）に測定子を移動するXY移動機構とレンズ枠の動径方
向に対する垂直な上下方向（Z方向）に測定子を移動するZ移動機構と有する測定子移動
機構を持ち、前記測定子の移動を検知してレンズ枠の三次元形状を得る測定ユニットと、
両枠トレース時に前記測定ユニットを左右方向に移動させる左右移動機構と、
 を備える眼鏡枠形状測定装置において、
両枠トレース時に前記測定ユニットが左右移動される際に前記測定子が通過可能なように
前記第 1 又は第 2 スライダーに形成された通路であって、前記 Z 移動機構が前記測定子を
移動させる上下方向で前記クランプピンより下側に形成された通路と、
一方のレンズ枠の測定終了後に前記測定子移動機構及び左右移動機構を制御し、前記測定
子を前記第 1 又は第 2 スライダーに形成された前記通路に移動させ、他方のレンズ枠を測
定するための所定の初期位置に前記測定子を移動させる制御手段と、
 を備えることを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【請求項 2】

請求項 1 の眼鏡枠形状測定装置において、
前記制御手段は、一方のレンズ枠の測定終了後に前記 Z 移動機構を制御して前記測定子を
前記クランプピンより下側に移動させ、次に前記 XY 移動機構を制御して前記クランプピ
ンより下を通過させて前記測定子を前記通路に移動させ、次に前記左右移動機構を作動さ
せることにより前記通路を通過させて他方のレンズ枠側に前記測定子を移動させ、次に前
記 XY 移動機構を制御して前記クランプピンより下を通過させて他方のレンズ枠の初期位
置に前記測定子を移動させることを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【請求項 3】

請求項 2 の眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、一方のレンズ枠の測定終了後
 にクランプピンの下を通過させて前記測定子を前記通路に移動させる位置を、そのレンズ

枠の形状測定結果に基づいて設定することを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【請求項 4】

請求項 1 ~ 3 の何れかの眼鏡枠形状測定装置は、一方のレンズ枠の測定終了後に他方のレンズ枠の初期測定位置に測定子を移動させる際に、前記通路を通過させて測定子を移動させる第 1 経路と前記通路を通過させずに測定子を移動させる第 2 経路とを選択する選択手段を備え、

前記制御手段は、前記第 2 経路が選択されたときは、一方のレンズ枠の測定終了後に前記左右移動機構を制御し、左右のレンズ枠の下を通過させて他方のレンズ枠の初期位置に直接測定子を移動させることを特徴とする眼鏡枠形状測定装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

(1) 眼鏡フレームの右レンズ枠及び左レンズ枠をそれぞれクランプするクランプピンを持ち、右レンズ枠及び左レンズ枠の左右方向(X方向)に対してフレーム装用時の縦方向(Y方向)から右レンズ枠及び左レンズ枠を押圧して保持する第1スライダー及び第2スライダーを有する眼鏡フレーム保持手段と、測定子をレンズ枠の溝に沿って移動させる測定子移動機構を有する測定ユニットであって、レンズ枠の動径方向(XY方向)に測定子を移動するXY移動機構とレンズ枠の動径方向に対する垂直な上下方向(Z方向)に測定子を移動するZ移動機構と有する測定子移動機構を持ち、前記測定子の移動を検知してレンズ枠の三次元形状を得る測定ユニットと、両枠トレース時に前記測定ユニットを左右方向に移動させる左右移動機構と、を備える眼鏡枠形状測定装置において、両枠トレース時に前記測定ユニットが左右移動される際に前記測定子が通過可能なように前記第1又は第2スライダーに形成された通路であって、前記Z移動機構が前記測定子を移動させる上下方向で前記クランプピンより下側に形成された通路と、一方のレンズ枠の測定終了後に前記測定子移動機構及び左右移動機構を制御し、前記測定子を前記第1又は第2スライダーに形成された前記通路に移動させ、他方のレンズ枠を測定するための所定の初期位置に前記測定子を移動させる制御手段と、を備えることを特徴とする。

(2) (1)の眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、一方のレンズ枠の測定終了後に前記Z移動機構を制御して前記測定子を前記クランプピンより下側に移動させ、次に前記XY移動機構を制御して前記クランプピンより下を通過させて前記測定子を前記通路に移動させ、次に前記左右移動機構を作動させることにより前記通路を通過させて他方のレンズ枠側に前記測定子を移動させ、次に前記XY移動機構を制御して前記クランプピンより下を通過させて他方のレンズ枠の初期位置に前記測定子を移動させることを特徴とする。

(3) (2)の眼鏡枠形状測定装置において、前記制御手段は、一方のレンズ枠の測定終了後にクランプピンの下を通過させて前記測定子を前記通路に移動させる位置を、そのレンズ枠の形状測定結果に基づいて設定することを特徴とする。

(4) 請求項 1 ~ 3 の何れかの眼鏡枠形状測定装置は、一方のレンズ枠の測定終了後に他方のレンズ枠の初期測定位置に測定子を移動させる際に、前記通路を通過させて測定子を移動させる第 1 経路と前記通路を通過させずに測定子を移動させる第 2 経路とを選択する選択手段を備え、

前記制御手段は、前記第 2 経路が選択されたときは、一方のレンズ枠の測定終了後に前記左右移動機構を制御し、左右のレンズ枠の下を通過させて他方のレンズ枠の初期位置に直接測定子を移動させることを特徴とする。

